

日立電子顕微鏡 ソリューション製品紹介

米国アライド社製 マルチプレップシステムのご紹介

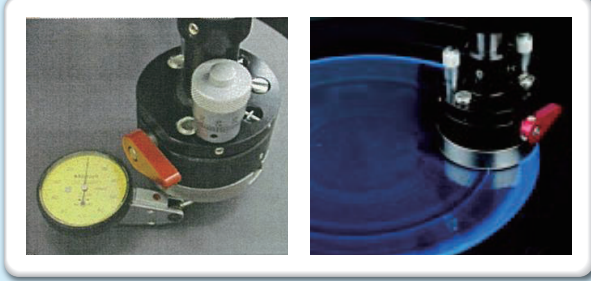


研磨量のコントロールや研磨面の平坦度維持など
高精度での研磨加工が期待できます。

SEM/TEMなどで試料観察するための研磨加工に対して、再現性のある試料作製が可能です。

角度調整と平行研磨

マイクロメータヘッドは、最大5度、0.02度の精度で微妙な角度の調整が可能です。高精度傾斜研磨のほか、プラテンと試料との平行度を校正することで平行研磨が行えます。



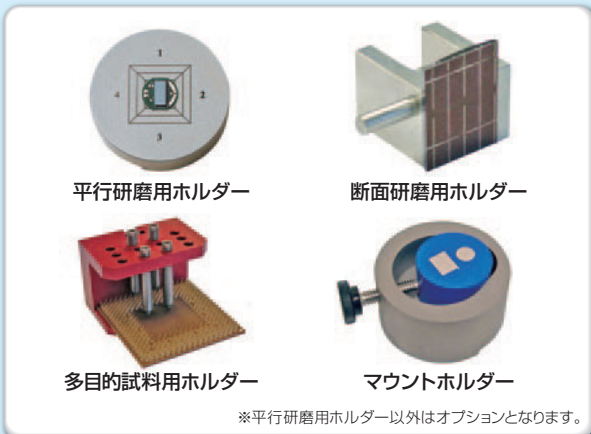
研磨量管理

デジタルインジケータを使い、リアルタイムに試料表面からの研磨量を $1\mu\text{m}$ 単位で確認することができます。また、研磨量の設定も $1\mu\text{m}$ 単位で可能です。

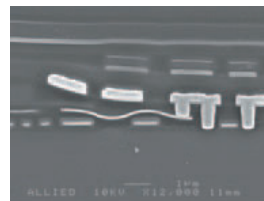


包埋処理レス

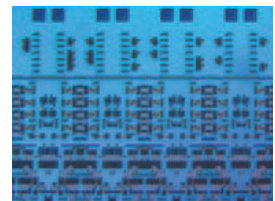
さまざまな形状の試料を、樹脂包埋せずに研磨装置に固定することが可能です。工具を使用せずに各種ホルダーの取り付け/取り外しが行えます。



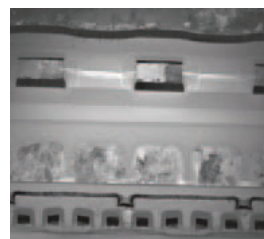
研磨試料観察例



SEM IC断面観察例



DIC IC平行研磨観察例



TEM IC断面観察例

[仕様]

名称	マルチプレップシステム	
プラテンタイプ	8インチプラテンタイプ	12インチプラテンタイプ
電源仕様	AC115V, 3A, 50/60Hz	AC115V, 3A, 50/60Hz
外形寸法	幅381 × 奥行き660 × 高さ508 (mm)	幅560 × 奥行き660 × 高さ535 (mm)
質量	57kg	75kg
試料荷重設定	0～500g	
プラテン回転速度	10～350RPM (5RPM毎に変)	
オプション	アライド社製研磨液供給装置の接続可能 緊急停止ボタンの組み込み可能	
標準納期	75日	

ご使用に際しては、給水排水設備が必要となります。

給水ホース外径1/4インチ(6.3mm) 排水ホース外径1-1/2インチ(40mm)ホースが、本体に接続されております。

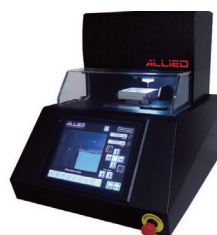
そのほか、お客様の用途にあわせてさまざまな装置をご案内いたします



Mプレップ5

Mプレップ研磨装置

手動による研磨装置です。プラテンサイズに応じて8インチ、10インチ、12インチタイプがあります。デュアルタイプもご用意しております。



Xプレップ

精密ミリング・ポリッシングシステムです。専用の切削・研磨治具を用いて、高精度な切削・研磨を可能とします。試料の局所的な研削加工に有効です。



メットプレップ3/PH-3システム

メットプレップPHシステム

包埋試料研磨装置です。少量から大量の試料作製に適しております。プラテン・試料回転速度、試料加圧などの各種パラメータについて、最大25ステップのプログラム設定が可能です。



テックカット5

高速切断機です。試料送り速度や荷重を制御しつつ切断を行います。多様な試料固定治具をご用意し、様々な種類やサイズの試料の切断に対応できます。

注意

ご使用前に、取扱説明書・注意事項をご確認のうえ、正しくお使いください。

詳細は弊社サービスエンジニアまでお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社 日立ハイテックフィールドディング

電子顕微鏡部

〒105-6410

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー

<https://www.hitachi-hightech.com/hfd/>

お客様サポートセンター

0120-203-813

S.I.navi 日立ハイテック会員制サイト(エスアイナビ)
<https://biz.hitachi-hightech.com/sinavi/>

(製造元) Allied High Tech Products, Inc.

2376 East Pacifica Place Rancho Dominguez, CA 90220

<http://www.alliedhightech.com/>

●本カタログに掲載の内容は、予告なく変更することがあります。

●本カタログに掲載の写真や図は標準仕様の場合です。装置の仕様や構成により異なります。

本カタログは2020年1月現在のものです。

DS1502005Rev.02